01,05,13

Влияние внешних факторов на ширину линии ферромагнитного резонанса в структурах с обменным смещением

© И.О. Джунь, Г.В. Бабайцев, М.Г. Козин, И.Л. Ромашкина, Е.И. Шанова, Н.Г. Чеченин

Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Москва, Россия

E-mail: irina.dzhun@gmail.com

Поступила в Редакцию 5 сентября 2020 г. В окончательной редакции 24 февраля 2021 г. Принята к публикации 28 февраля 2021 г.

> Исследованы внешние факторы, влияющие на ширину линии ферромагнитного резонанса (Φ MP) в двухслойных (ферромагнетик/антиферромагнетик) системах с обменным смещением. Исследованы зависимость ширины линии Φ MP от толщины антиферромагнитного ($A\Phi$) слоя при неизменной толщине ферромагнитного (Φ) слоя для образцов с различным порядком осаждения Φ - и $A\Phi$ -слоев, а также корреляция между полем обменного смещения и шероховатостью поверхности образца. Обнаружено, что обменное смещение дает незначительный вклад в ширину линии Φ MP. В системах с антиферромагнетиком, нанесенным на ферромагнитный слой, ширина линии Φ MP увеличивается пропорционально среднему размеру шероховатости поверхности. В системах с обратным расположением слоев значительный вклад в ширину линии дает одноосная анизотропия. Ширина линии Φ MP находится в квадратичной зависимости от одноосной анизотропии и в обратно пропорциональной зависимости от толщины антиферромагнитного слоя, что можно отнести к изменению микроструктуры с толщиной в качестве внешнего фактора демпфирования Φ MP.

> Ключевые слова: ферромагнитный резонанс, ширина линии, обменное смещение, одноосная анизотропия, шероховатость поверхности.

DOI: 10.21883/FTT.2021.06.50924.185

1. Введение

Исследование динамики намагниченности в наноразмерных магнитных структурах занимает важное место в сегодняшних исследованиях по нескольким причинам. В низкоразмерных устройствах, таких как сенсоры и спиновые диоды, принцип действия которых основан на эффекте гигантского магнитного сопротивления (ГМС), скорость переориентации намагниченности слоя является ключевым фактором. Динамика оценивается затуханием прецессии намагниченности относительно ее равновесного состояния [1-3]. Значение спинового затухания определяет ширину линии ФМР, которая является важной характеристикой для разработки устройств. В свою очередь, величина затухания зависит от ряда факторов, которые можно условно разделить на внешние и внутренние [4,5]. Среди внутренних факторов наиболее значительным является спин-орбитальное взаимодействие, которое определяется конфигурацией и размером магнитокристаллического поля (гильбертовское затухание) [6].

При использовании различных методов получения тонкие магнитные пленки могут иметь монокристаллическую либо поликристаллическую структуру. Известно, что поликристаллические структуры характеризуются гораздо большими значениями ширины линии ФМР, по сравнению с монокристаллическими. Главной причиной уширения линии ФМР в поликристаллических структурах обычно считается двухмагнонный механизм спинспиновой релаксации, вызванный структурными несовершенствами, такими как хаотичная взаимная ориентация зерен и морфология поверхности [7]. Внешние факторы определяются условиями осаждения ферромагнитного слоя и его последующей обработки. Вклад данных факторов вызывает особый интерес, поскольку режимы осаждения структуры и последующей обработки могут быть намеренно изменены [8]. В работах [9,10]показано, что двухмагнонный механизм вносит наиболее значительный вклад в ширину линии ФМР, возрастающий при уменьшении толщины ферромагнитной пленки, в то время как для большинства структур вкладом внутреннего гильбертовского затухания можно пренебречь.

Другим важным вопросом является влияние одноосной магнитной анизотропии и обменного смещения на ширину линии ФМР для тонкопленочных структур вида ферромагнетик/антиферромагнетик ($\Phi/A\Phi$). В работах [10,11] получено, что при изменении толщины Ф-слоя ширина линии ФМР растет пропорционально квадрату величины обменного смещения вне зависимости от порядка осаждения Ф- и АФ-слоев. В то же время при изменении толщины АФ-слоя не было обнаружено корреляции обменного смещения и ширины линии ФМР, несмотря на то, что и обменное смещение, и ширина линии ФМР возрастают при увеличении толщины АФ-слоя [11,12].

В данной работе исследовано влияние внешних факторов на ширину линии Φ MP в поликристаллических структурах вида $\Phi/A\Phi$ с обменным смещением при изменении толщины $A\Phi$ -слоя и порядка осаждения Φ - и $A\Phi$ -слоев. Обнаружено, что обменное смещение оказывает пренебрежимо малое влияние на ширину линии Φ MP. В то же время вклад одноосной магнитной анизотропии, микроструктура и шероховатость границы раздела Φ - и $A\Phi$ -слоев могут быть наиболее существенными внешними факторами.

2. Изготовление и методы исследования образцов

магнетронного Методом распыления были получены две серии многослойных структур вида Ta/NiFe/IrMn/Ta (TS-структуры) и Ta/IrMn/NiFe/Ta (BS-структуры). Структуры осаждались на подложку из монокристаллического кремния с кристаллографической ориентацией (100). Для улучшения адгезии и формирования микрокристаллической структуры последующих слоев на пластину кремния наносился буферный (затравочный) слой Та толщиной 30 nm, далее проводилось осаждение Ф- и АФ-слоев в альтернативной последовательности. Для обеих серий образцов толщина ферромагнитного слоя NiFe составляла 10 nm, а толщина антиферромагнитного слоя IrMn варьировалась в пределах 10-40 nm с шагом в 10 nm. Для защиты от окисления и механических повреждений образцы покрывались сверху защитным слоем Та толщиной 30 nm.

Перед осаждением образцов камера магнетрона откачивалась до давления 10^{-7} Torr. Осаждение образцов проводилось в аргоне при давлении $3.5 \cdot 10^{-3}$ Torr. Ферромагнитный слой Ni₈₀Fe₂₀ был получен путем соосаждения из мишеней Ni и Fe, в то время как антиферромагнитный слой осаждался из мишени IrMn. Толщины слоев были определены из скоростей осаждения пленок. Скорости осаждения определялись по толщине калибровочных слоев, измеренной методом резерфордовского обратного рассеяния, и составляли порядка 3.7 nm/min.

Морфология поверхности образцов исследовалась методом атомно-силовой микроскопии (ACM) на установке IntegraSpecta NT-MDT в полуконтактном режиме. Характеристикой образцов являлось полученное значение среднеквадратичной шероховатости $\sigma_{rms} = \langle \Delta h^2 \rangle^{1/2}$, где Δh — отклонение высоты поверхности в данной точке сканирования от среднего значения, а также латеральная средняя площадь $\langle S \rangle$ топологических дефектов (островки и ямки на поверхности).

Магнитные свойства полученных образцов исследовались методом ферромагнитного резонанса с частотой 9.65 GHz. Постоянное магнитное поле ФМР (*H* на рис. 1), направленное вдоль поверхности образца, сканировалось в диапазоне до 6 kOe. Основные магнитные характеристики образцов получались из угловых зависимостей резонансного магнитного поля, $H_r(\alpha)$, где α угол между направлением поля ФМР и направлением магнитного поля, приложенного при осаждении образца. Основные соотношения, связывающие магнитные характеристики и угловую зависимость $H_r(\alpha)$, приводятся ниже.

ФМР в структурах с обменной связью

Запишем выражение для свободной энергии связанного с антиферромагнетиком ферромагнитного слоя

$$F = 2\pi M_S^2 \cos^2 \theta - M_S H \sin \theta \cos(\varphi - \alpha)$$
$$-M_S H_{EB} \sin \theta \cos(\varphi - \beta) + \frac{M_S H_K}{2} \sin^2 \theta \sin^2(\varphi - \eta),$$
(1)

где M_S — намагниченность в насыщении, H_K , H_{EB} — поле одноосной и однонаправленной (обменное смещение) магнитной анизотропии. Обозначения углов поясняются на рис. 1. Ферромагнитный слой находится в плоскости xy, направление магнитного поля, приложенного при осаждении образца H_A совпадает с осью x. Первый член в выражении (1) отвечает за энергию размагничивания — при ее расчете принимаем форм-фактор пленки равным: $N_x = 0$, $N_y = 0$, $N_z = 4\pi$.

Второй член в выражении для свободной энергии (1) отвечает за зеемановскую энергию взаимодействия намагниченности слоя с внешним магнитным полем, третий и четвертый члены — за энергию взаимодействия намагниченности с однонаправленной и одноосной анизотропией соответственно. Похожая форма для свободной энергии применялась, например, в статьях [13–15].



Рис. 1. Направления полей и намагниченности в ферромагнитном слое.

Условие для резонанса

$$\left(\frac{\omega}{\gamma}\right)^2 = \frac{1}{M_s^2 \sin^2 \theta} \left(F_{\theta\theta} F_{\varphi\phi} - F_{\theta\phi}^2\right) \tag{2}$$

было получено независимо в целом ряде работ: [16-18].

Условия минимума для свободной энергии (1) $F_{\theta} = 0$, $F_{\varphi} = 0$ выполняются при значениях углов $\theta_{\min} = \frac{\pi}{2}$, $\varphi_{\min} = \alpha$ для соотношения полей $4\pi M_S \gg H_{EB} + H_K$, которое выполняется в большинстве практических случаев. Подставляя вторые производные при значениях θ_{\min} , φ_{\min} в (2), получаем

$$\left(\frac{\omega}{\gamma}\right)^{2} = \left[4\pi M_{S} + H_{r} + H_{EB}\cos(\alpha - \beta) - H_{K}\sin^{2}(\alpha - \eta)\right] \times \left[H_{r} + H_{EB}\cos(\alpha - \beta) + H_{K}\cos 2(\alpha - \eta)\right]$$
(3)

и резонансное поле H_r

$$H_r = \frac{(\omega/\gamma)^2}{4\pi M_S + H_r + H_{EB}\cos(\alpha - \beta) - H_K\sin^2(\alpha - \eta)} - H_{EB}\cos(\alpha - \beta) - H_K\cos 2(\alpha - \eta).$$
(4)

Неколинеарность одноосной и однонаправленной анизотропий, $\beta \neq 0^{\circ}$, наблюдалась в ряде экспериментов [19]. Так в нашей работе [20] установлено, что угол неколинеарности между H_{EB} и H_K значителен, т. е. $\beta \neq 0^{\circ}$, при малых толщинах АФ-слоя менее 10 пт и постепенно уменьшается при бо́льших толщинах, в то время как η близко к нулю при всех исследованных толщинах АФ.

Соотношения (3,4) упрощаются, если за ось *x* принять направление одноосной анизотропии, $\eta = 0^{\circ}$ (или 180°, что не меняет соотношения (3,4). Учитывая малость полей по сравнению с $4\pi M_S (4\pi M_S \gg H_r)$, получаем

$$\left(\frac{\omega}{\gamma}\right)^2 = 4\pi M_S (Hr + H_{EB}\cos(\alpha - \beta) + H_K\cos 2\alpha) \quad (5)$$

И

$$Hr = \frac{(\omega/\gamma)^2}{4\pi M_S} - H_{EB}\cos(\alpha - \beta) - H_K\cos 2\alpha.$$
(6)

Аналогичные соотношения, но без учета угла неколинеарности β , были получены в работе [17].

Исходя из измеренных резонансных полей для ориентации внешнего поля ФМР вдоль и поперек оси легкой намагниченности, H_r^0 , H_r^{90} , H_r^{180} , H_r^{270} , соответственно, для $\alpha = 0^\circ$, 90° , 180° и 270° получаем следующее выражение для величины обменного смещения:

$$H_{EB} = \frac{\left[(H_r^{270} - H_r^{90})^2 + (H_r^{180} - H_r^0)^2 \right]^{1/2}}{2}.$$
 (7)

Данное выражение может использоваться для оценки величины обменного смещения с учетом неколинеарности одноосной и однонаправленной магнитной анизотропии. Однако в настоящей работе приводимые ниже величины полей были получены путем аппроксимации угловой зависимости резонансного поля $H_r(\alpha)$ выражением (6).

4. Экспериментальные результаты

Спектры ФМР позволяют определить значение резонансного поля *H_r* и ширину резонансной линии ФМР ΔH (как разницу между максимумом и минимумом линии дифференциального спектра поглощения ФМР). Угловая зависимость резонансного поля $H_r(\alpha)$, может быть аппроксимирована соотношением (6) поскольку для экспериментальных данных выполняется условие $4\pi M_S \gg H_r$ (так, значения $4\pi M_S$ для исследованных образцов составляют порядка 11.5 kOe, в то время как значения H_r составляют менее 1 kOe). Использование соотношения (6) позволяет определить значения резонансного поля в отсутствии анизотропии и обменного смещения, $H_{r0} = (\omega/\gamma)^2/(4\pi M_S)$, поля обменного смещения H_{EB} , поля одноосной анизотропии H_K и угла неколинеарности β . Присутствие неколинеарности, $\beta \neq 0$, иллюстрируется на рис. 2, где пунктирной линией изображена аппроксимирующая зависимость $H_r(\alpha)$ в отсутствие неколинеарности, а сплошной линией при $\beta = 15^{\circ}$.

Ширина линии ФМР была измерена при значениях угла α взаимной ориентации внешнего поля ФМР и направления магнитного поля, приложенного при осаждении образцов, в 0 и 90 градусов. Эти два угла соответствуют измерениям при направлении магнитного поля вдоль ОЛН-образца и перпендикулярно ОЛН-образца. Результаты в зависимости от толщины АФ-слоя приведены на рис. 3. Обращают на себя внимание два обстоятельства. Первое — значительное расхождение в ширинах линий ФМР для ТS- и BS-структур: ΔH_{TS} существенно меньше, чем ΔH_{BS} . Второе — значения ΔH для $\alpha = 0^{\circ}$ и $\alpha = 90^{\circ}$ совпадают в пределах экспериментальной точности и синхронно повторяют вариации с толщиной. Исключение составляют результаты для BS-образцов с толщиной АФ-слоя 30 пт.

Зависимость величины обменного смещения от толщины АФ-слоя для TS- и BS-структур показана на



Рис. 2. Угловая зависимость поля ФМР для TS-образца с толщиной АФ-слоя 10 nm. Линиями показана аппроксимация экспериментальных результатов соотношением (6) (с $\beta = 0$ — пунктирная линия и $\beta = 15^{\circ}$ — сплошная линия).

рис. 4, *а*. Несмотря на некоторые количественные различия, качественный вид зависимостей совпадает для обоих типов структур.

Зависимость шероховатости поверхности образцов обоих типов от толщины АФ-слоя показана на рис. 4, *b*. Из рисунка видно, что значение σ_{rms} для TS-образцов больше, чем для BS. Также можно заметить, что зависимости значения σ_{rms} от толщины АФ-слоя в TS- и BS-структурах находятся в противофазе.

Более детальное исследование влияния среднеквадратичной шероховатости поверхности образцов на величину обменного смещения приведено в работе [21].

5. Обсуждение результатов

Важно отметить, что свойства двухелойных структур вида Ф/АФ с различным порядком осаждения Ф- и АФ-слоев могут различаться из-за различий механизмов роста слоев [11,22]. В ТS-структурах Ф-слой осаждается непосредственно на буферный слой Та, в значительной степени повторяя его шероховатость. При увеличении толщины АФ-слоя в структурах такого типа микроструктурные параметры Ф-слоя, такие как размер зерна



Рис. 3. Зависимость ширины линии ФМР для параллельной и перпендикулярной ориентации ОЛН образца относительно внешнего поля ФМР от толщины А Φ -слоя в TS (a) и BS (b) образцах.



Рис. 4. Зависимость обменного смещения в TS- и BS-структурах от толщины А Φ -слоя (*a*). Зависимость среднеквадратичной шероховатости поверхности TS- и BS-структур от толщины А Φ -слоя (*b*).

и текстура, не претерпевают существенных изменений. В то же время величина обменного смещения может изменяться из-за изменения анизотропии АФ-слоя при изменении его толщины [23].

В случае, если поле обменного смещения направлено вдоль легкой оси образца ($\beta = 0^{\circ}$), вклад однонаправленной анизотропии НЕВ в величину резонансного поля *H_r* может быть существенным при измерениях вдоль легкой оси и должен отсутствовать при измерениях перпендикулярно легкой оси, в соответствии с уравнением (6). Аналогичного эффекта можно ожидать и для ширины линии ФМР. Тот факт, что ширины линий ФМР для $\alpha = 0^{\circ}$ и для $\alpha = 90^{\circ}$ в случае TS-структур практически совпадают (рис. 3, а), говорит о том, что, либо обменное смещение отсутствует, либо влияние обменного смещения на ширину линии ФМР пренебрежимо мало по сравнению с влиянием других факторов. Поскольку первое предположение опровергается рис. 4, а, следует признать, что справедливо последнее. Однако, это противоречит выводам, содержащимся в некоторых других публикациях.

Так, линейная зависимость ширины линии Φ MP ΔH от H_{EB} была предложена в работе [12], где предпо-

лагалось, что эффективное поле в Ф-слое изменяется пропорционально обменному полю, создаваемому в Ф-слое поли-, микро- или нанокристаллическим слоем АФ. Квадратичная зависимость $\Delta H \sim H_{EB}^2$ была выведена в работах [4,10], основанных на подходе Ариаса и Миллса [24]. В этом подходе уширение линии ФМР является результатом флуктуации обменной связи из-за шероховатости границы раздела Ф/АФ. Наши результаты показывают, что, несмотря на большие вариации шероховатости (рис. 4, *b*) и обменного смещения (рис. 4, *a*) в образцах TS, ширины линии ФМР для $\alpha = 0^{\circ}$ и $\alpha = 90^{\circ}$ в пределах статистических ошибок совпадают (рис. 3, *a*) и, следовательно, значительного влияния H_{EB} на ширину линии ФМР не наблюдается.

В то же время влияние шероховатости поверхности образцов на ширину линии ФМР достаточно заметно, о чем свидетельствует рис. 5. Сплошная линия на рисунке представляет собой аппроксимацию экспериментальных данных по ширине линии ФМР, ΔH , для серии TS-образцов зависимостью, которую можно записать в виде

$$\Delta H_{TS} \propto \sqrt[3]{\sigma_{rms}S}.$$
 (8)

Здесь: S — средняя площадь дефектов, значение $\sqrt[3]{\sigma_{rms}S}$ представляет собой средний линейный размер дефектов на поверхности образца. На рис. 5 показано, что экспериментальные данные хорошо описываются такой зависимостью между ΔH и средним размером морфологических дефектов поверхности. Это согласуется с известными результатами [25], где продемонстрирована связь ширины линии ФМР с размером зерна, и [26], где предсказана линейная связь между ΔH и радиусом пор на поверхности образца. В других работах предсказана линейная зависимость ΔH от удельного объема пор [7] и площади дефектов [27,4,10,28] на поверхности образца. При этом экспериментальные данные о зависимости ширины линии ФМР с топологическими дефектами на поверхности или интерфейсе многослойных структур практически отсутствуют.

В образцах BS, где Ф-слой растет на слое АФ, микроструктура АФ-слоя может влиять на свойства осажденного на него Ф-слоя. Увеличение толщины слоя АФ может привести, например, к увеличению размера зерен АФ в объеме и на границе раздела АФ/Ф. Нанесенный сверху слой Ф принимает типичный размер зерна АФ, т.е. размер зерна Ф, возможно, увеличивается с увеличением толщины слоя АФ. Значительно большие абсолютные значения ширины линии ФМР для образцов BS (по сравнению с TS) подтверждают это предположение (рис. 3, a и 3, b). Предполагается, что уширение линий ФМР для BS-структур по сравнению с TS-структурами не связано с обменным смещением. Подтверждение незначительности влияния обменного смещения следует из рис. 3, *b*, где ΔH_{BS} для $\alpha = 0^{\circ}$ либо близко, либо меньше, чем для $\alpha = 90^{\circ}$, за исключением образца с $t_{AF} = 40$ nm. Кроме того, было показано, что шероховатость поверхности ВS-образцов меньше, чем TS (рис. 4, b), что говорит о том, что шероховатость также не является причиной уширения линии ФМР.

Этот краткий анализ дает основание утверждать, что единственным фактором, влияющим на уширение ΔH при наложении поля вдоль трудной оси по сравнению с легкой осью в образцах BS, является одноосная магнитокристаллическая анизотропия *H_K*. Учитывая, что образцы имеют поликристаллическую структуру, мы предполагаем, что работает приближение сильно связанных зерен с $H_K \ll 4\pi M_s$. В этом приближении поликристалл рассматривается как однородная среда с неоднородным эффективным полем, на которое влияет наличие зерен с различной кристаллографической ориентацией. Магнитные флуктуации зерен связаны друг с другом через размагничивающие поля [7], что приводит к нескомпенсированной кристаллографической анизотропии, способствующей усилению одноосной анизотропии и вызывающей плавные пространственные колебания намагниченности. Пространственно-флуктуирующая намагниченность, так называемая "микромагнитная рябь (ripple)", наблюдающаяся в лоренцевской просвечивающей микроскопии [29,30], коррелирует с размером зерна [23]и может быть если не основным, то дополнительным источником уширения линии ФМР [31]. Основываясь на модели Ариаса и Миллса [19], и используя подход Резенде и др. [10], примененный для оценки уширения линии ФМР под влиянием обменного смещения, экспериментальная зависимость ширины линии ФМР, ΔH , может быть аппроксимирована квадратичной зависимостью от одноосной анизотропии Н_К. Квадратичная зависимость $\Delta H(H_K)$ была получена в работе [20]. Для выделения на фоне других конкурирующих вкладов, на рис. 6 квадратичная зависимость представлена в виде разности ширин ФМР линий для $\alpha = 90^{\circ}$ и $\alpha = 0^{\circ}$ как

$$\Delta H_{BS}^{90} - \Delta H_{BS}^0 = A H_K^2 + B, \qquad (9)$$

где *A* и *B* подгоночные параметры. Как видно из рис. 6, данное соотношение хорошо описывает эксперименталь-



тичной шероховатости поверхности ТS-образцов. Сплошная

линия является аппроксимацией экспериментальных данных

соотношением (8)



Рис. 6. Зависимость разности ширин линий ФМР для BS-образцов. Сплошной линией показана аппроксимация экспериментальных результатов соотношением (9).



Рис. 7. Зависимость ширины линии ФМР от толщины АФ-слоя для BS образцов. Линии приведены в соответствии с уравнением (10).

ные данные для BS-структур при значениях параметров $A = 0.15 \pm 0.02, B = 4.8 \pm 2.4.$

Таким образом, показано, что единственным фактором, влияющим на уширение ΔH для трудной оси по сравнению с легкой осью в образцах BS, является наличие пространственных осцилляций одноосной магнитокристаллической анизотропии, которые, как мы предполагаем, связаны не с шероховатостью, как предложено в работе [10], а с не полностью скомпенсированной магнитокристаллической анизотропией поликристаллического Ф-слоя в BS-структуре, как предложено в работе [23]. В отличие от BS-, в TS-структуре подобный анализ выполнить невозможно ввиду меньших абсолютных значений ширин и их разности $\Delta H_{TS}^{90} - \Delta H_{TS}^{0}$, рис. 3, *а*.

Исследования зависимости ширины линии ФМР от толщины слоя антиферромагнетика в структуре типа АФ/Ф весьма немногочисленны [12]. Гораздо больше результатов было опубликовано по зависимости ФМР от толщины слоя ферромагнетика, $\propto 1/t_F^p$, с разными показателями p: p = 1 в работах [10,12,32], что соответствует затуханию намагниченности за счет рассеяния на поверхностных (межфазных) дефектах, $p = 1.5 \pm 0.2$ в [19] и p = 3, предложенными для более толстых ферромагнитных пленок в рамках двухмагнонного механизма рассеяния [33].

На рис. 7 приведены экспериментальные данные по зависимости ΔH^0_{BS} от толщины слоя антиферромагнетика и проведены кривые, соответствующие зависимости $1/t^p_{AF}$: для разных значений *p*:

$$\Delta H^0_{BS}(t_{AF}) - \Delta H^0_{BS}(t_{AF} = \infty) \propto \frac{1}{t^p_{AF}}.$$
 (10)

При значениях показателя p = 1, 2 и 3 ширины линий ФМР для массивного АФ-слоя составляют, соответственно, $\Delta H^0_{BS}(t_{AF} = \infty) = 140 \pm 19$, 158 \pm 10, 163 \pm 7 Oe.

Значения показателей степени для Φ и А Φ находятся в одном диапазоне. Это указывает на общую причину такой зависимости как при изменении толщины Φ -слоя, так и при изменении толщины А Φ -слоя, так как в обоих случаях происходит изменение микроструктуры (рост размера зерна) с увеличением толщины слоя. Рост размера зерна провоцирует увеличение угловой дисперсии однонаправленной анизотропии А Φ -слоя и угловой дисперсии намагниченности А Φ -слоя, что приводит к росту ширины линии Φ MP, как показано в работе [23].

6. Заключение

Внешние факторы, влияющие на ширину линии ФМР, были исследованы в системах Ф/АФ с различным порядком осаждения слоев (TS, BS). Вклада однонаправленной анизотропии в ширину линии ФМР в исследуемых образцах не наблюдалось. Ширина линии ФМР в TSобразцах увеличивалась пропорционально среднему размеру дефектов на поверхности образцов. Для структур BS такой зависимости не наблюдалось, что можно объяснить гораздо меньшими значениями среднеквадратичной шероховатости поверхности образца и, по-видимому, более гладкой поверхностью слоя АФ на границе раздела АФ- и Ф-слоев.

В структурах вида $A\Phi/\Phi$ было обнаружено, что в ширину линии Φ MP, измеренной вдоль трудной оси, значительный вклад вносит не однонаправленная, а одноосная анизотропия. Разница в значениях ширины линий Φ MP, измеренных вдоль трудной и легкой оси, изменяется пропорционально квадрату H_K .

Ширина линии ФМР вдоль легкой оси в образцах BS уменьшается с увеличением толщины слоя АФ примерно, как $1/t_{AF}^{p}$, при p = 1-3. Сходная форма зависимости ширины линии ФМР от толщины Ф- и АФ-слоев свидетельствует о сходстве внешних факторов, формирующихся в слое Ф при росте слоев. Мы предполагаем, что это микроструктурные факторы, такие как размер зерна.

Финансирование работы

Работа выполнялась в рамках государственного задания тема № 01201268472.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] E. Schlomann, R. Tutison, J. Weissman, H.J. Van Hook, T. Vatimos. J. Appl. Phys. 63, 3140 (1988).
- [2] R.E. Camley, D.L. Mills. J. Appl. Phys. 82, 3058 (1997).
- [3] N. Cramer, D. Lucic, R.E. Camley, Z. Celinski. J. Appl. Phys. 87, 6911 (2000).
- [4] D.L. Mills, S.M. Rezende. Spin Dynamics in Confined Magnetic Structures II. Topics Appl. Phys. 87, 27-59 (2003) / Ed. B. Hillebrands, K. Ounadjela. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (2003).
- [5] M. Sparks M, R. Loudon, C. Kittel. Phys. Rev. 122, 791 (1961).
- [6] R.C. LeCraw, E.G. Spencer, C.S. Porter. Phys. Rev. 110, 1311 (1958).
- [7] A.G. Gurevich, G.A. Melkov. Magnetization Oscillation and Waves. CRC Press, N.Y. (1996).
- [8] B. Heinrich: Ferromagnetic resonance in ultrathin structures / Eds B. Heinrich, J.A.C. Bland. Ultrathin magnetic structures II. Springer, Berlin, Heidelberg (1994). Ch. 3.
- [9] B.K. Kuanr, R.E. Camley, Z. Celinski. J. Appl. Phys. 93. 7723 (2003).
- [10] S.M. Rezende, A. Azevedo, M.A. Lucena, F.M. de Aguiar. Phys. Rev. B 63, 214418 (2001).
- [11] S. Yuan, B. Kang, L. Yu, S. Cao, X. Zhao. J. Appl. Phys. 105, 063902 (2009).
- [12] W. Stoecklein, S.S.P. Parkin, J.C. Scott. Phys. Rev. B 38, 6847 (1988).
- [13] A. Layadi, W.C. Cain, J.-W. Lee, J.O. Artman. IEEE Transact. Magn. 23, 2993 (1987).
- [14] M. Diaz de Sihues, C.A. Durante-Rincón, J.R. Fermin. JMMM 316, e462 (2007).
- [15] R.D. McMichael, M.D. Stiles, P.J. Chen, W.F. Egelhoff. Jr. Phys. Rev. B 58, 8605 (1998).
- [16] H. Suhl. Phys. Rev. 97, 2, 555 (1955).
- [17] J. Smit H., H.G. Beljers. Phillips. Res. Rep. 10, 1, 113 (1955).
- [18] T. Gilbert, A Lagrangian. Phys. Rev. 100, 1243 (1955).
- [19] H.C. Choi, C.Y. You, K.Y. Kim, J.S. Lee, J.H. Shim, D.H. Kim. Phys. Rev. B 81 (2010) 224410.
- [20] I.O. Dzhun, G.V. Babaytsev, N.G. Chechenin, Ch.A. Gritsenko, V.V. Rodionova. JMMM 470, 151 (2019).
- [21] Е.И. Шанова, И.О. Джунь, Н.Г. Чеченин. Перспективные материалы (Неорган.материалы: Прикладные исследования). 11, 5 (2013). Е.I. Shanova, I.O. Dzhun, N.G. Chechenin. Perspect. Mater. Inorganic Mater.: Appl. Res. 5, 2, 89 (2014).
- [22] Е.В. Хоменко, Н.Г. Чеченин, И.О. Джунь, Н.С. Перов, В.В. Самсонова, А.Ю. Гойхман, А.В. Зенкевич. ФТТ 52, 1583 (2010).
- [23] K. O'Grady, L.E. Fernandez-Outon, G. Vallejo-Fernandez. J. Magn. Magn. Mater. 322, 883 (2010).
- [24] R. Arias, D.L. Mills. Phys. Rev. B 60, 7395 (1999).

- [25] R.C. LeCraw, E.G. Spencer, C.S. Porter. Phys. Rev. 110, 6, 1311 (1958).
- [26] M. Sparks, R. Loudon, C. Kittel. Phys. Rev. 122, 3, 791 (1961).
- [27] R. Arias, D.L. Mills. Phys. Rev. B 60, 10, 7395 (1999).
- [28] B.K. Kuanr, R.E. Camley, Z. Celinski. J. Appl. Phys. 95, 6610 (2004).
- [29] N.G. Chechenin, C.B. Craus, A. Chezan, T. Vystavel, D.O. Boerma, J.Th.M. De Hosson, L. Niesen. IEEE Trans. Magn. MAG 38, 5, 3027 (2002).
- [30] N.G. Chechenin. J. Magn. Magn. Mater. 300, 198 (2006).
- [31] Н.Г. Чеченин. ФТТ 46, 3, 466 (2004).
- [32] V. Speriosu, S. Parkin, C. Wilts. IEEE Trans. Magn. MAG 23, 5, 2999 (1987).
- [33] R.D. McMichael, M.D. Stiles, P.J. Chen, W.F. Egelhoff Jr. J. Appl. Phys. 83, 7037 (1998).

Редактор Т.Н. Василевская